

Synopsys REFLET 180S Bench

3D (半球領域) 散乱測定器

BRDF/BTDF

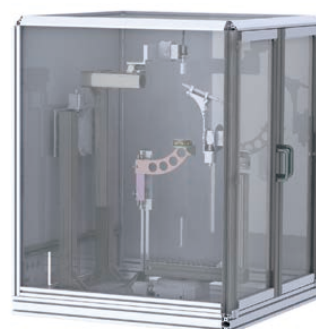
2D/3D 散乱光測定用

適用例

- フォトリソスティック
レンドリング：分光特性を
正確に測定
- 光センサー：医療、製造、
品質管理、自動車
- 照明器具設計に利用する
反射材質の測定
- 自動車用ヘッドランプに
利用する反射材質の測定
- 化粧品の反射特性：分光特性と
正反射光の振る舞い
- 製造現場の品質管理
- 半導体製造における粉塵／
微粒子のコントロール
- LCDバックライト
- 透過ガラスの散乱
- 航空宇宙への応用、黒塗料の
測定、反射板のBRDF測定



Synopsys REFLET 180S



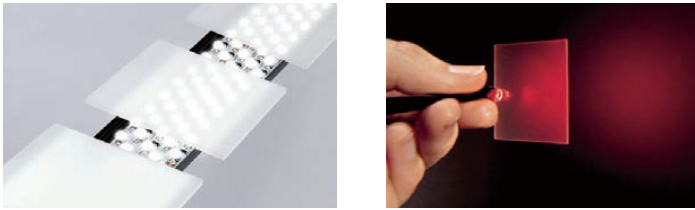
Synopsys REFLET 180S



コンプリートシステム

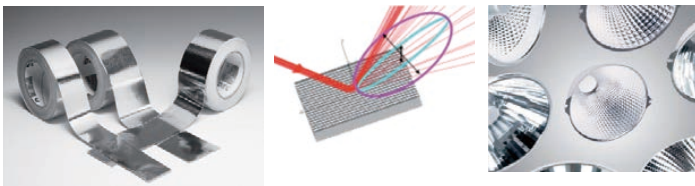
SYNOPSYS REFLET 180S

あらゆるタイプの材料の散乱特性を測定できるコンパクトな光学的駆動システムです。散乱光に含まれる光エネルギー分布や分光分布を、迅速かつ正確に、そして簡単に測定することができます。Synopsys REFLET 180Sは、面粗さ、欠陥、コーティング、塗料などの対象表面の特徴を検査することができます。さらに、BRDF/BTDFを測定することができます。BRDF/BTDFは、表面に入射した光が散乱する様子を3次元空間全体で表現しています。



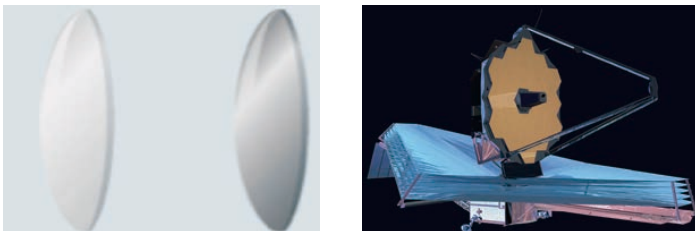
拡散板

反射と透過で測定を行います。拡散板の光の反射と透過の様子を理解することは、光学システムに材料を使用するために必要です。



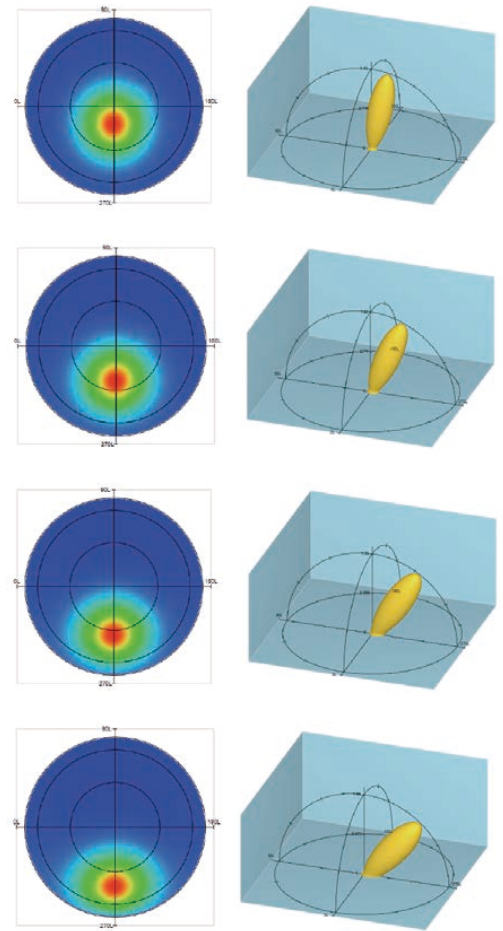
アルミニウム

反射材は、入射面に応じて非常に複雑な挙動を示すことがあります。Synopsys REFLET 180Sは異なる入射面での正確な測定を可能にします(例:異方性材料や偏光依存性など)。

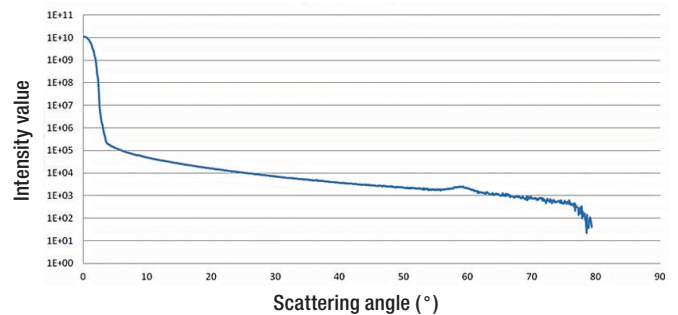


研磨した光学面

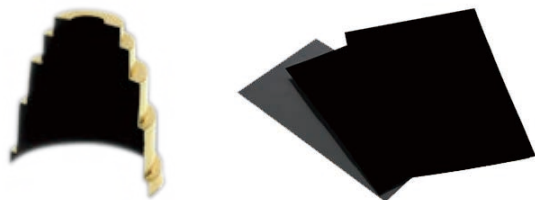
鏡面や、ガラス、レンズ、結晶などの透明な面は、 10^{-9} sr $^{-1}$ のような非常に低い散乱を持つことがあります。これらの表面を測定するには、高いダイナミックレンジを持つ検出システムが必要です。Synopsys REFLET 180Sは 10^{-5} sr $^{-1}$ 以下のBRDF測定に対応しています。



3Dスキャン

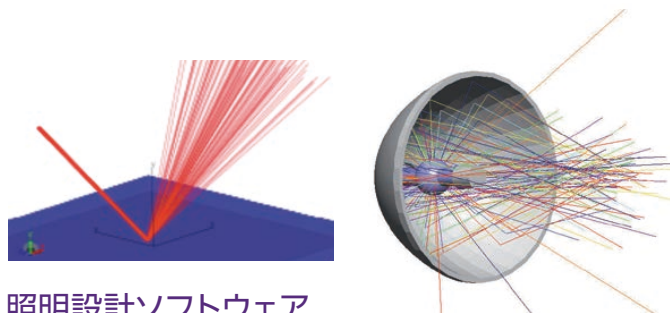


ダイナミックレンジ



黒色材料

主に航空宇宙分野で使用する黒色材料やコーティングは、強力な測定器でないと測定が困難です。これらの材料は、大量の光を吸収するため、非常に低いBRDFの検出が必要です(反射率1%未満)。Synopsys REFLET 180Sは、低いBSDFを高ダイナミック検出器で取得できます。



照明設計ソフトウェア

照明設計ソフトウェアで正確なシミュレーションを行うためには正確なデータが必要です。Synopsys REFLET 180SはTracePro、ASAP、LightTools、LucidShape、Photopia、SPEOSで読み込み可能な2D/3D BRDFまたはBTDFファイルを提供しています。



リアル・レンダリング・ソフトウェア

自動車をはじめとする多くの業界では、光学設計者がリアルなレンダリングを行うために、可能な限り物理的に正確なシミュレーションを行うことが求められています。Synopsys REFLET 180Sはヘッドランプ、テールランプ、ダッシュボード等への光特性の評価を行うことができます。また、散乱測定データを提供し、光学設計ソフトウェアに取り込むことができます。

化粧品

化粧品メーカーは口紅やクリームを製造するために、様々な化学物質の混合物を比較する必要があります。Synopsys REFLET 180Sは、このような製品を肌の上で、また異なる照明(異なる分光特性)の下で特性を評価することができます。

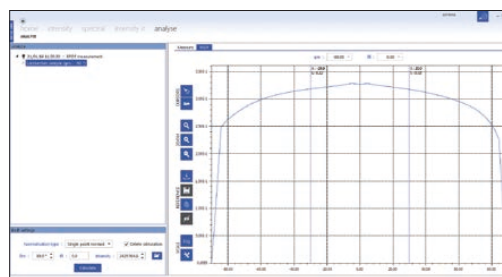


日本シノプシス合同会社

〒158-0094 東京都世田谷区玉川2-21-1 二子玉川ライズオフィス e-mail : osg_sales_japan@synopsys.com

技術仕様

技術仕様										
投光										
光源ボックス	<ul style="list-style-type: none"> ハロゲン 100W オプション: 6ポジションのフィルターホイール (R/G/Bフィルターを含む) 									
サンプル面のスポットサイズ	<ul style="list-style-type: none"> 散乱設定: 手でϕ1mmからϕ13mmまで調整可 									
ビーム開口部の角度	<ul style="list-style-type: none"> 散乱設定: 手で$\pm 0.15^\circ$から$\pm 2.26^\circ$まで調整可 									
ゴニオメータ	標準バージョン: <ul style="list-style-type: none"> 0°-180° で駆動 (反射/透過) 角度分解能: 選択可 ($0.01^\circ/0.1^\circ/1^\circ/10^\circ$) ポジション精度: 0.01° 									
検出										
光集積検出器	<ul style="list-style-type: none"> 可視光: 400 - 1000nm, ダイナミック $10^{\wedge}9$ 近赤外光: 900 - 1700nm, ダイナミック $10^{\wedge}6$ (オプション) 									
分光器 (オプション)	<ul style="list-style-type: none"> 有効波長域: 420 - 900nm 分光分解能: 選択可 ($0.6\text{nm}/1\text{nm}/5\text{nm}/10\text{nm}$) 									
光学システム	<ul style="list-style-type: none"> 散乱設定: <ul style="list-style-type: none"> 手で交換可能な光学ブロック (3つの中から2つを選択) 光学ブロック <table border="1"> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> </tr> </table> 許容角度 <table border="1"> <tr> <td>$\pm 2^\circ$</td> <td>$\pm 1.1^\circ$</td> <td>$\pm 0.04^\circ$</td> </tr> </table> 受光エリアサイズ <table border="1"> <tr> <td>ϕ14mm</td> <td>ϕ8mm</td> <td>ϕ6mm</td> </tr> </table> 	1	2	3	$\pm 2^\circ$	$\pm 1.1^\circ$	$\pm 0.04^\circ$	ϕ 14mm	ϕ 8mm	ϕ 6mm
1	2	3								
$\pm 2^\circ$	$\pm 1.1^\circ$	$\pm 0.04^\circ$								
ϕ 14mm	ϕ 8mm	ϕ 6mm								
ゴニオメータ	<ul style="list-style-type: none"> θ: $-90^\circ \sim 90^\circ$ で駆動可能 ϕ: $-90^\circ \sim 90^\circ$ で駆動可能 角度分解能: 選択可能 ($0.01^\circ/0.1^\circ/1^\circ/10^\circ$) 位置決め精度: 0.01° 									
ポラライザ/アナライザ (オプション)	<ul style="list-style-type: none"> 簡易挿入形式 0°-90° 手動回転式 									
測定時間										
180° profile (オプション)	<ul style="list-style-type: none"> "フラックス集積" モード: 45秒 "分光" モード: 45秒 									
Software										
データ変換	<ul style="list-style-type: none"> テキストファイル (ASTM) BSDFフォーマット (市販ソフトウェアで取込可) 									



Synopsys REFLET 180S Software

リファレンス

ADC, Alanod, Alcan, Almedco, Automotive-Lighting, AUO, Arcelor, Bourget, Ball Aerospace, BARCO, Chanel, Dupont, Entire, Essilor, Helbling, Hewlett Packard, Loepfe, STMicroelectronics, Procter & Gamble, PSA, University of Darmstadt, University of Madrid, Volkswagen,... Synopsys' DesignWare® Foundation IP, Interface IP, Security IP, and Processor IP are optimized for high performance, low latency, and low power, while supporting advanced process technologies from 16-nm to 5-nm FinFET and future process nodes.